

BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

fenl gungsschrDE 196 01 109 A 1

(5) Int. Cl.⁶: G 02 B 21/00

H 01 L 21/306 H 01 L 33/00



DEUTSCHES

PATENTAMT

 (21) Aktenzeichen:
 196 01 109.4

 (22) Anmeldetag:
 13. 1.96

(3) Offenlegungstag: 17, 7, 97

71) Anmelder:

Laser- und Medizin-Technologie gGmbH, Berlin, 12207 Berlin, DE

(74) Vertreter:

Christiansen, H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 14195 Berlin

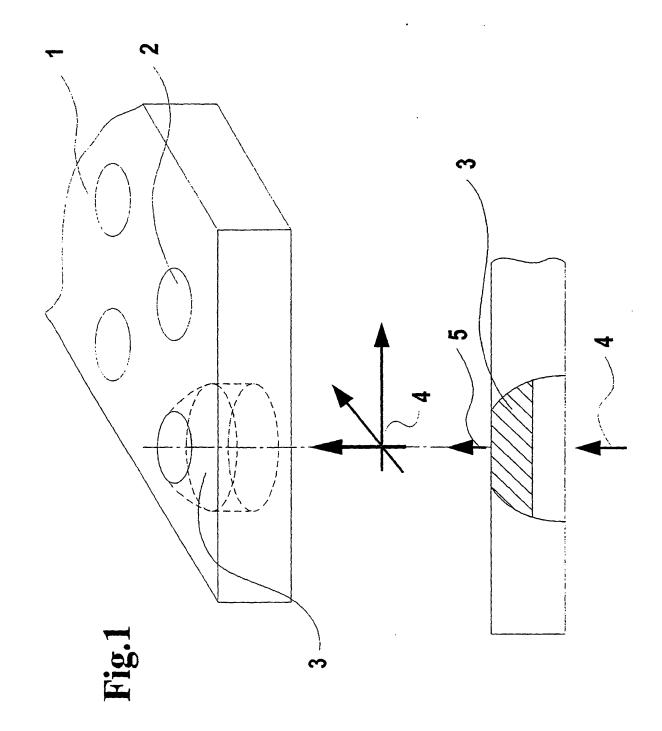
2 Erfinder:

Müller, Gerhard, Prof. Dr.-Ing., 14129 Berlin, DE; Beuthan, Jürgen, Prof. Dr.rer.nat., 12165 Berlin, DE

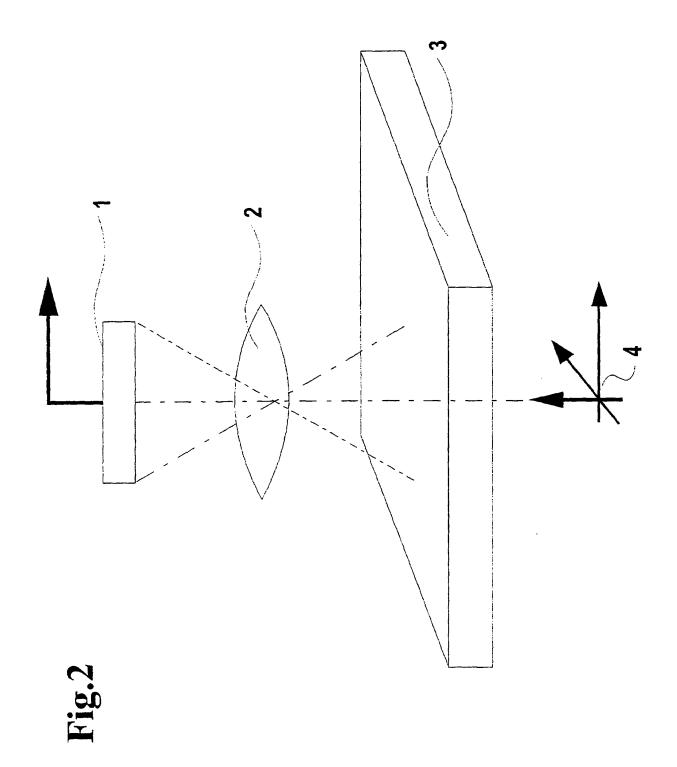
(54) Zweidimensionale optische Nahfeldlichtquelle

Die Erfindung betrifft die Entwicklung eines Verfahrens und einer Vorrichtung, mit der die Untersuchungsmethoden der optischen Nahfeldmikroskopie ohne mechanisch bewegte Teile und bei vergrößertem Objektfeld angewandt werden können.

Zur Realisierung der hochauflösenden optischen Nahfeldmikroskopie und -spektroskopievorrichtung wird eine Vielzahl optischer Nahfeldlichtquellen in Form eines Arrays in einem Siliziumsubstrat eingebracht und die Anregung dieser zweidimensionalen Nahfeldlichtquellen-Array-Anordnung erfolgt durch ebenfalls zweidimensionales Abtasten mittels einer energiereichen Strahlung. - Leerseite -



Nummer: In 3: On regungstag: **DE 196 01 109 A1 G 02 B 21/00**17. Juli 1997



702 029/280